Численное моделирование спектров резерфордовского обратного рассеяния ионов от многослойных многокомпонентных мишеней Кибардин А. В.

Кибардин Алексей Владимирович / Kibardin Alexey Vladimirovich - кандидат физико-математических наук, доцент, кафедра вычислительной техники,

Физико-технологический институт,

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург

Аннотация: в работе рассматриваются вопросы численного моделирования спектров резерфордовского обратного рассеяния ионов в тонких пленках. **Abstract:** the work deals with the numerical modeling of the spectra of Rutherford backscattering of ions in thin films.

Ключевые слова: тонкие пленки, ион, упругое рассеяние, спектры, математическое моделирование. *Keywords*: thin films, ion elastic scattering spectra, mathematical modeling.

Наиболее интересную информацию в исследованиях изменения атомного состава в процессах диффузии и твердофазных реакций в тонких порядка нескольких десятков или сотен нм пленках дает методика резерфордовского обратного рассеяния заряженных частиц. Она позволяет получить количественную информацию о распределении атомов по глубине образца без его разрушения и не требует калибровки с использованием внешних стандартов. Это дает возможность проводить анализ сложных многослойных систем, например, используемых в микроэлектронике. Однако количественный анализ спектров обратного рассеяния от таких систем требует использования адекватной математической модели и компьютерной обработки результатов.

Теоретическое описание процесса упругого рассеяния тяжелых быстрых ионов с энергией дано в ряде работ, например [1-3]. Быстрый ион, двигаясь в твердом теле, теряет свою энергию за счет двух процессов: рассеяния на электронах атомов мишени и рассеяния на атомах мишени. Взаимодействие с электронами, будучи основным фактором потери ионом энергии, вызывает лишь небольшие отклонения траектории иона. Взаимодействие с ядрами атомов, при условии, что начальная энергия иона не превышает 1 МэВ/нуклон, можно рассматривать как упругое столкновение с чисто кулоновским потенциалом взаимодействия. На рис. 1 показано рассеяние иона с зарядом z_1 и начальной энергией E_0 на большой угол (>90°) двухслойной мишенью (толщина первого слоя много меньше полной длины пробега иона). Количество ионов, рассеянных на угол θ в малом слое толщиной dt на глубине t в элемент телесного угла $\Delta\Omega$, дается выражением (1):

$$F(E_2) = Nn \frac{d\sigma(E_1, \theta)}{d\Omega} \Delta \Omega dt / \cos \theta_1, \qquad (1)$$

где n – величина потока падающих ионов; N – концентрация атомов мишени; $d\sigma/d\Omega$ – дифференциальное сечение упругого рассеяния ионов; E_1 – энергия иона на глубине t непосредственно перед рассеянием; E_2 – энергия, к которой регистрируется ион, рассеянный на глубине t.

Дифференциальное сечение упругого рассеяния ионов описывается выражением (2):

$$\frac{d\sigma(E_1,\theta)}{d\Omega} = \left(\frac{z_1 z_2 e^2}{E_1}\right)^2 \left[\sqrt{1 - \left(\frac{m_1}{m_2} \sin \theta\right)^2} + \cos \theta\right]^2,\tag{2}$$

где m_1 , m_2 , z_1 , z_2 – массы и зарядовые числа налетающего иона и атома мишени соответственно, θ – угол рассеяния в лабораторной системе координат.



Рис. 1. Схема однократного упругого рассеяния иона с начальной энергией Ео двухслойной мишенью

Для определения энергии необходимо знать пробег частиц в веществе до столкновения. Его можно определить, решив систему уравнений (3):

$$\begin{cases} t / \cos \theta_1 = -\int_{E_0}^{E_1} \frac{dE}{S(E)} \\ t / \cos \theta_2 = -\int_{\alpha E_1}^{E_2} \frac{dE}{S(E)} \end{cases}$$
(3)

Здесь S(E) - удельные потери иона в веществе.

Проблема заключается в необходимости использования экспериментальных данных удельных потерь иона в веществе, которые не могут быть описаны аналитической зависимостью во всем диапазоне энергий от начальной и до нуля.

Поскольку в исследованиях тонких пленок для нас представляют интерес глубины в веществе t, много меньшие полного пробега ионов R_p , будем рассматривать удельные потери в интервале энергий 0,2 < E < 1 МэВ/нуклон. В этом диапазоне удельные потери ионов в веществе с хорошей точностью можно аппроксимировать функциональной зависимостью $S(E)=A \cdot exp(-\beta)$. Это позволяет получить из решения системы (3) простые аналитические выражения, связывающие начальную энергию E_0 и конечную энергию E_2 иона с глубиной рассеяния t в веществе [4, с. 50]:

$$t = \frac{\cos\theta_1 \cos\theta_2}{(\cos\theta_1 + \alpha^{\beta+1} \cos\theta_2)A(\beta+1)} [(\alpha E_0)^{\beta+1} - E_2^{\beta+1}], \tag{4}$$

где α – кинематический фактор, определяющий долю энергии, уносимую упруго рассеянной частицей; θ_1 , θ_2 – углы падения и отражения соответственно; A, β – коэффициенты аппроксимации энергетических потерь частицы.

Энергия частицы непосредственно перед упругим рассеянием на глубине *t* определяется из (3) с учетом аппроксимации (формула (5)):

$$E_1 = \left[E_0^{\beta+1} + \frac{A(\beta+1)t}{\cos\theta_1} \right]^{\frac{1}{\beta+1}},\tag{5}$$

Для получения выхода рассеяния от следующего слоя (рис. 1) необходимо определить энергию E_3 . Ее можно рассчитать, зная толщину первого слоя t_a и последовательно вычисляя E₁ (энергия иона на границе со вторым слоем) и E_4 (энергия иона на границе со слоем A после рассеяния в слое вещества B на глубине t_b):

$$E_{4} = (E_{5}^{\beta_{a}+1} - A_{a}(\beta_{a}+1)t_{a}/\cos\theta_{2})^{\frac{1}{\beta_{a}+1}},$$
(6)

где

$$E_{5} = \left((\alpha_{b} E_{1}^{'})^{\beta_{a}+1} - A_{a} (\beta_{a}+1) t_{a} / \cos \theta_{1} \right)^{\frac{1}{\beta_{a}+1}}$$
(7)

- начало спектра обратного рассеяния от второго слоя. Индексы a и b относятся к соответствующим параметрам слоев А и В.

Далее, аналогично (4) для глубины t_b во втором слое получим соотношение (8):

$$t_{b} = \frac{\cos\theta_{1}\cos\theta_{2}}{(\cos\theta_{1} + \alpha^{\beta_{b}+1}\cos\theta_{2})A_{b}(\beta_{b}+1)} [(\alpha_{b}E_{b}^{'})^{\beta_{b}+1} - E_{4}^{\beta_{b}+1}]$$
(8)

Энергия иона перед рассеянием на глубине t_b (аналогично (5)) определяется выражением (9):

$$E_{3} = (E_{1}^{\beta_{b}+1} - A_{b}(\beta_{b}+1)t_{b} / \cos\theta_{1})^{\beta_{b}+1}$$
(9)

1

Аналогично ведутся расчеты для 3-го и последующих слоев.

Для того чтобы получить реальный спектр обратного рассеяния ионов, необходимо учесть флуктуации потерь энергии частицей из-за страгглинга Г_s и конечное энергетическое разрешение измерительной системы (так называемую аппаратную функцию) Г₀. Распределение энергии ионов после прохождения слоя вещества толщиной $t << R_p (R_p - полный пробег частицы в веществе) можно оценить с$ помощью приближения Бора:

$$\Gamma_{s} = 4\pi (8\ln 2) z_{1} z_{2} e^{4} N t \tag{10}$$

С учетом аппаратной функции измерительной установки и разброса энергии ионов при движении вглубь образца и на пути их выхода из образца после акта рассеяния выражение для распределения частиц по энергии примет вид (11):

$$\Gamma^2 = \Gamma_0^2 + \alpha \Gamma_s^2 + \Gamma_s^2 \tag{11}$$

Коэффициенты гауссовского распределения по энергии:

$$P_{ij}(E_{2i} - E_{2j}) = \frac{2\sqrt{\ln 2}}{\sqrt{\pi}\Gamma} \exp\left[-\frac{4\ln 2}{\Gamma^2}(E_{2j} - E_{2i})\right]^2$$
(12)

Здесь индексы *i*, *j* соответствуют разным энергетическим интервалам.

При расчете страгглинга в многокомпонентном слое мы использовали принцип линейной аддитивности, в соответствии с которым параметр Г для слоя, состоящего, например, из двух компонентов, определяется следующей формулой:

$$(\Gamma^{A_n B_m})^2 = n(\Gamma^a)^2 + m(\Gamma^b)^2 = 4\pi (8\ln 2) z_1 e^4 (z_2^a n N_a^{A_n B_m} + z_2^b m N_b^{A_n B_m}) t_{, (13)}$$

$$N^{A_n B_m} = N^{A_n B_m}$$

– парциальные концентрации элементов А и В; п, т – стехиометрические где $I\mathbf{v}_a$, $I\mathbf{v}_b$ коэффициенты.

Модифицированный с учетом коэффициентов (12) спектр обратного рассеяния ионов имеет вид:

$$H(E_{2i}) = \sum_{j=i-k}^{j=i+k} P_{ij}(E_{2i} - E_{2j})F_j(E_{2j}), \qquad (14)$$

где количество интервалов j=2k выбирается таким, чтобы оно примерно составляло 3σ гауссовского распределения.



Рис. 2. Спектры резерфордовского обратного рассеяния ионов водорода с начальной энергией 600 кэВ: • экспериментально полученный спектр от многослойной структуры W(31 нм) / SiO₂ (580 нм) /Si; – расчетный спектр

На основе предложенной модели нами разработан ряд программ, позволяющих моделировать спектры резерфордовского рассеяния и решать обратную задачу: по энергетическим спектрам рассчитывать профили атомных концентраций. На рис. 2 представлены пример расчета в сравнении с экспериментальными данными, полученными от многослойной структуры: пленки W толщиной 31 нм, нанесенной на окисленную поверхность монокристалла *Si* (слой окисла толщиной 580 нм). Как видно из рисунка, достигается хорошая точность в описании спектров вплоть до энергии ≈ 200 кэВ, соответствующей глубине порядка 1 мкм в подложке кремния.

Литература

- 1. Тонкие пленки. Взаимная диффузия и реакции. Под редакцией Поута Дж., Ту К., Мейера Дж. М.: Мир. 1982. 576 с.
- 2. Chu W. K., Mayer J. W., Nicolet M. A. Backscattering spectromety. N.-Y.:Academic Press. 1978. 384 p.
- 3. Шипатов Э. Т. Обратное рассеяние быстрых ионов. Ростов. Изд-во Ростовского гос. университета. 1988. 154 с.
- 4. *Кибардин А. В.* Изменение профилей концентрации атомов в тонкопленочных структурах Me-Si при тепловом и радиационном воздействиях.: Дисс... канд. физ.-мат. наук. Екатеринбург.: УГТУ. 1996.